¹¹ Влияние тонкого полимерного покрытия на автоэмиссионные свойства плоских металлических катодов

© А.Н. Ионов, Е.О. Попов, В.М. Светличный, А.А. Пашкевич

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург E-mail: ionov@tuch.ioffe.rssi.ru Институт высокомолекулярных соединений РАН, С.-Петербург

Поступило в Редакцию 14 ноября 2003 г.

Исследованы физические свойства нового класса автоэмиссионных эмиттеров — катодов на основе тонких полимерных покрытий. В качестве полимерного покрытия использовалась разновидность растворимого имид-силоксанового сополимера. Обнаружен эффект увеличения эмиссионного тока при достаточно стабильной полевой эмиссии плоских полированных молибденовых и ниобиевых катодов.

В настоящее время большое внимание уделяется поиску перспективных материалов для изготовления полевых эмиссионных катодов, стабильно работающих в условиях сравнительно низкого вакуума (не более 10^{-6} Torr). В научных публикациях и в патентах описано немало конструкций автоэмиссионных катодов (АЭ-катодов) на основе углеродсодержащих материалов. В частности, перспективными могут быть АЭкатоды на основе: 1) углеродных волокон [1,2]; 2) массивных углеродных пластин, обработанных радиационной технологией, что позволяет получать у исходно-плоских АЭ-катодов развитую поверхность [3]; 3) нанокластерных углеродных структур — нанотрубок [4]. В ряде работ также сообщалось об увеличении эмиссионного тока кремниевых и молибденовых острий при покрытии их алмазными пленками методами химического парафазного осаждения и электрофореза [5].

В настоящей работе исследованы физические свойства нового класса автоэмиссионных катодов — катодов на основе тонких полимерных покрытий. В качестве полимерного покрытия толщиной в $1-2\mu$ m использовалась разновидность растворимого имид-силоксанового сополимера, на котором ранее была обнаружена аномально высокая канальная проводимость, если его поместить между двумя метал-

77

78

лическими электродами [6]. При синтезе силоксан-имидного сополимера по методике, описанной в работе [7], образуется структура, состоящая, согласно [8], из полиэфиримидных блоков, составленных из чередующихся остатков диангидрида и ароматического диамина, и силоксанимидных блоков, включающих в себя чередующиеся остатки диангидрида и силоксанового диамина. Выбор полимера был обусловлен тем, что такой полимер, не являясь при комнатной температуре вязкотекучим, как полидиметилсилоксан, из-за наличия в структуре имидароматических фрагментов, образует прочные пленочные покрытия. При этом он обладает гибкими олигодиметилсилоксановыми и более жесткими имид-ароматическими фрагментами, соотношение которых можно регулировать и таким образом влиять на надмолекулярную структуру образующихся полимерных пленок. Модуль упругости и прочность на разрыв пленок толщиной $40\,\mu m$ составляют 40 ± 1 и 6.5 ± 0.3 MPa соответственно, а температура начала термодеструкции имид-силоксанового сополимера превышает 400°С. Пленки сополимера имеют хорошую адгезию к металлам.

Тонкие полимерные покрытия толщиной около 1 nm наносились на полированные молибденовые или ниобиевые катоды диаметром 5 mm методом растекания, для чего на катод наносилось рассчитанное количество 5%-ного раствора сополимера в обезвоженном N-метил-2-пирролидоне. Для удаления растворителя электрод с нанесенным раствором сополимера прогревался в сушильном шкафу при температуре 100° C в течение 1-2h при атмосферном давлении. Толщина пленки сополимера определялась с помощью интерференционного микроскопа типа МИИ-4.

Топография поверхности полимерной пленки анализировалась методом атомно-силовой микроскопии (ACM) в атмосферных условиях на приборе Solver P47 (НТМДТ, Россия), работающем в резонансном режиме. Использовались Si-зонды NSG11 (НТМДТ, Россия) с радиусом кривизны кончика зонда менее 40 nm. ACM топография поверхности полимерной пленки до исследования эффекта автоэлектронной эмиссии показала, что шероховатость поверхности не превышает 30 nm. Это позволяет считать поверхность полимерной пленки достаточно ровной.

Эксперименты по изучению автоэлектронной эмиссии проходили в вакууме 10^{-6} Torr. Расстояние между плоским катодом и анодной сеткой составляло 0.5–1.5 mm. В качестве сетки использовалась теневая маска от обычного кинескопа. Регистрация изображения с плоского



Рис. 1. Работа полевого эмиттера на основе сополимера, диаметр катода 5 mm.

люминесцирующего экрана производилась с помощью телекамеры с последующей записью в память компьютера. Экран находился под потенциалом сетки и располагался на небольшом расстоянии от сетки, обеспечивая увеличение изображения до 4 раз.

Измерение вольт-амперных (ВАХ) характеристик осуществлялось методом сканирования высоким напряжением с частотой 50 Hz как в прямом, так и в обратном направлениях. Одновременная запись значений тока и напряжения производилась на компьютере при помощи двухканального цифрового осциллографа. В данных экспериментах использовалась плата собственной разработки для стандартного слота расширения персонального компьютера с частотой выборки 100 ks/s и разрядностью 16 бит на канал.

Нижний порог напряженности электрического поля, при котором начиналась регистрация автоэмиссионного тока с катода, покрытого имид-силоксановым сополимером, составляла $4 \, kV/mm$. Однако для первичной активизации эмиттера требовались напряженности поля, превышающие данное значение в 2.5-3 раза. Отметим, что электронная эмиссия с полированных электродов (без полимерного покрытия) не наблюдается вплоть до $25 \, kV/mm$.

На рис. 1 показано свечение люминесцирующего экрана под действием электронов, эмитированных плоским ниобиевым катодом,



Рис. 2. *а* — АСМ-топография: модифицированная поверхность с остриями высотой до 400 nm. *b* — вольт-амперная эмиссионная характеристика имид-силоксанового сополимера (ниобиевая подложка) в координатах Фаулера—Нордгейма.

покрытым полимерной пленкой при напряженности электрического поля, равной 6 kV/mm. Как видно из фотографии, эмитирующие центры распределены по всей поверхности катода.

Исследование АСМ-топографии поверхности полимерной пленки показало, что после изучения эффекта автоэлектронной эмиссии поверхность полимера сильно модифицировалась: возникли острия высотой до 400 nm (рис. 2, *a*). Образование полимерных острий в достаточно сильном электрическом поле можно понять как результат проявления эффекта локальной электризации полимера вследствие самоинжекции носителей заряда в сравнительно эластичную полимерную матрицу из металлического электрода [9].



Рис. 2 (продолжение).

Обратимая вольт-амперная характеристика (ВАХ), измеренная при небольших напряжениях, согласуется с теорией Фаулера—Нордгейма, что указывает на автоэмиссионный характер работы катода с полимерным покрытием (рис. 2, b). Однако с ростом напряжения (свыше 6000 V) измеренный ток оказывается меньше.

Как показали рентгеновские исследования, после нескольких часов работы эмиттера при напряженности поля в межэлектродном промежутке $E > 10 \, \mathrm{kV/mm}$ и токах эмиссии $I > 1 \, \mathrm{mA}$ в полимерной пленке образуется большое количество углеродсодержащих областей вследствие термодеструкции полимера. Это указывает на локальный разогрев полимерного покрытия токами эмиссии свыше 700°С. При этом были обнаружены заметный массоперенос углеродсодержащего материала на анод, а также неравномерность свечения люминесцирующего экрана — одни эмитирующие центры прекращали свое существование, другие же образовывались вновь.

Таким образом, использование полимерного покрытия в качестве эмиттера автоэмиссионного тока может быть перспективным для ряда задач, поскольку: 1) базируется на энергосберегающей технологии; 2) обладает простотой изготовления — не требуется специального предварительного заострения поверхности эмиттера; 3) достаточно устойчиво к бомбардировке ионами остаточных газов в условиях технического вакуума.

Работа выполнена при поддержке гранта "Физика твердотельных наноструктур".

Авторы благодарят А.В. Анкудинова за проведение АСМ измерений.

Список литературы

- [1] Lea C. // J. Phys. D: Appl. Phys. 1973. V. 6. P. 1105.
- [2] Baker F.S., Osborn A.R., Williams J. // J. Phys. D: Appl. Phys. 1973. V. 7. P. 2105.
- [3] Куликов Д.В., Суворов А.Л., Сурис Р.А. и др. // Письма в ЖТФ. 1997. Т. 23.
 В. 14. С. 89.
- [4] Chernozatonskii L.A., Kosakovskaya Z.Ya., Gulyaev Yu.V., Sinitsyn N.I. et al. // J. Vac. Sci. Technol. 1996. V. B14. N 3. P. 2080.
- [5] Geis M.W., Twichell J.C., Lyszczarz T.M. // J. Vac. Sci. Technol. B. 1996. V. 14 (3). P. 2060–2067.
- [6] Ionov A.N., Zakrevskii V.A., Svetlichnyi V.M., Rentzsch R. // In Abstract of 10th Int. Symp. "Nanostructure: Physics and Technology". St. Petersburg, Russia, June 17–21, 2002. P. 531.
- [7] Yilgor J., Johnson B.C. // Amer. Chem. Soc. Polymer Preprints. 1986. V. 27. P. 54.
- [8] Светличный В.М., Архипова Е.В., Денисов В.М. и др. // Высокомолек. соед. 1990. А32. С. 2075.
- [9] Lowell J., Rose-Innes A.C. // Adv. Phys. 1980. V. 29. P. 947.